

半导体物理与器件

任课教师: 赵小龙 电信学部微电子学院 zhaoxiaolong@xjtu.edu.cn

目录

· 前沿——课程信息

第一部分: 半导体物理

- · 第一章 半导体中的电子状态
- · 第二章 半导体中载流子的统计分布
- · 第三章 半导体的导电性
- · 第四章 非平衡载流子
- · 第五章 金属和半导体的接触

第二部分: p-n结

第三部分: 双极晶体管

第四部分:金属-氧化物-半导体场效应晶体管

· 4.1 非平衡载流子的注入与复合

处于热平衡态半导体, T一定, n_0 , p_0 一定 - 平衡载流子浓度 非简并半导体 有 $n_0 p_0 = n_i^2$ - 热平衡态的判据式

• 4.1 非平衡载流子的注入与复合

4.1.1 平衡载流子和非平衡载流子的关系

对半导体施加外部作用(光照、电注入等),破坏热平衡,成为非平衡态。载流子浓度比平衡态的多些,多余的那部分用 Δn , Δp 表示,称其为非平衡载流子或过剩载流子。用n或p表示总的载流子浓度。

$$n = n_0 + \Delta n$$

$$p = p_0 + \Delta p$$

平衡态: $n_0 p_0 = n_i^2$

非平衡态:
$$np = (n_0 + \Delta n)(p_0 + \Delta p) \neq n_i^2$$

・ 4.1 非平衡载流子的注入与复合

4.1.2 非平衡载流子的产生与复合

非平衡载流子的产生

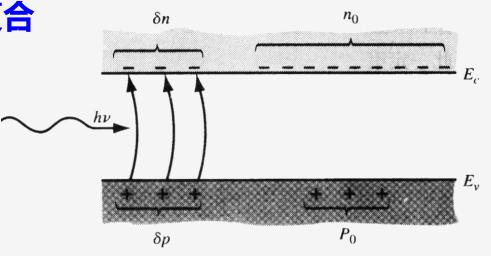
产生率: 单位时间单位体积中

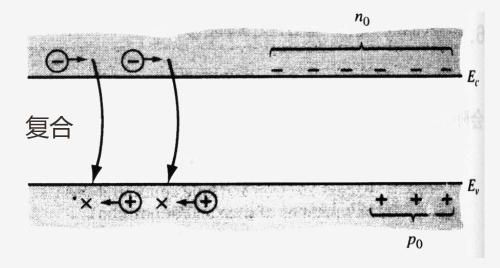
产生的载流子数

非平衡载流子的复合

复合率: 单位时间单位体积中

复合的载流子数





· 4.1 非平衡载流子的注入与复合

4.1.2 非平衡载流子的产生与复合

光注入: 当用一東光子能量大于半导体禁带宽度的光照射处于 热平衡状态的半导体时, 价带电子因为吸收光子而跃迁到导带, 形成电子空穴对。(光照产生非平衡载流子) 这一过程使得载流子数量超过热平衡状态时的载流子数量。超 出的这部分载流子, 称为**非平衡载流子**。

在光照强度一定的情况下, (1) 开始, 载流子的产生率>复合率,产生非平衡载流子, (2) 随着非平衡载流子浓度的增加,复合率升高, (3) 最后,产生率=复合率,达到**稳态**。 半导体内有稳定的 Δn 和 Δp 。

- 4.1 非平衡载流子的注入与复合
- 4.1.2 非平衡载流子的产生与复合

多子、少子概念:

- ◆ n型半导体: n为多数载流子, Δn 为非平衡多数载流子(**非平衡多子**), p为少数载流子, Δp 为非平衡少数载流子(**非平衡少子**)
- ◆ p型半导体: p为多数载流子, Δp 为非平衡多数载流子 (**非平衡多子**), n为少数载流子, Δn 为非平衡少数载流子 (**非平衡少子**)

· 4.1 非平衡载流子的注入与复合

例子 1Ω •cm的n型半导体: $n_0 \approx 5.5 \times 10^{15}$ cm⁻³, $p_0 \approx 3.1 \times 10^4$ cm⁻³ $\Delta n = \Delta p = 10^9$ cm⁻³, $\Delta n \ll n_0$, $\Delta p \gg p_0$ $n = n_0 + \Delta n \approx 5.5 \times 10^{15}$ cm⁻³ $p = p_0 + \Delta p \approx 10^9$ cm⁻³

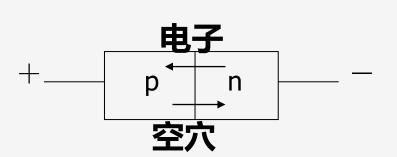
- 平衡少数载流子通常非常少,非平衡载流子浓度往往比平衡少数载流子大得多;
- 多数载流子受非平衡载流子影响很小,而非平衡载流子浓度几乎决定了少数载流子浓度。
- ▶ 非平衡半导体中非平衡少数载流子对半导体特性影响起主要作用,主要考虑非平衡少子的情况。

• 4.1 非平衡载流子的注入与复合

4.1.3 非平衡载流子的注入(产生)和检验

1.光注入:光照

2.电注入: pn结 (少数载流子注入)



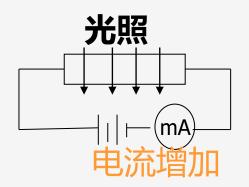
◆非平衡载流子的检测:

非平衡态
$$J = \sigma |E| = (nq\mu_n + pq\mu_p)|E|$$
平衡态 $J_0 = \sigma_0 |E| = (n_0 q\mu_n + p_0 q\mu_p)|E|$

$$J = [(n_0 + \Delta n)q\mu_n + (p_0 + \Delta p)q\mu_p]|E|$$

$$= (n_0 q\mu_n + p_0 q\mu_p)|E| + (\Delta nq\mu_n + \Delta pq\mu_p)|E|$$

$$= \sigma_0 |E| + \Delta \sigma |E| \qquad \text{附加电导率}$$



• 4.2 非平衡载流子的寿命

(撤掉注入会如何?)

撤销光照,非平衡载流子并不会马上消失,而是逐渐减小并最终回到热平衡状态(净复合过程)。该过程的快慢由非平衡载流子的平均生存时间,即非平衡载流子的寿命r决定。

(1)定义

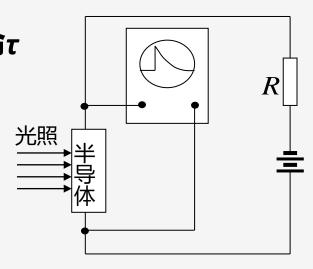
非平衡载流子的平均生存时间 - - 寿命で

(2)非平衡载流子寿命的测量

直流光电导测量法

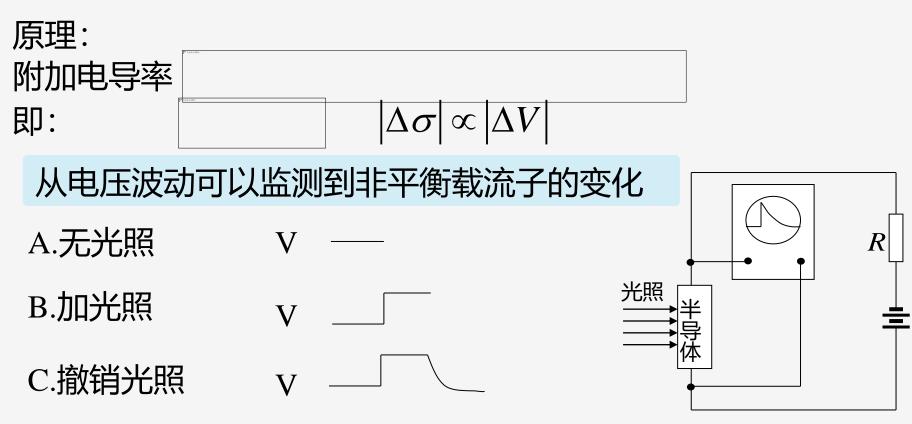
半导体中通过恒定电流, 监测半导体

两端电压降变化



• 4.2 非平衡载流子的寿命

(2)非平衡载流子寿命的测量



• 4.2 非平衡载流子的寿命

(2)非平衡载流子寿命的测量

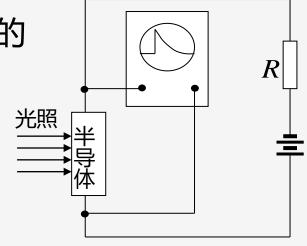
 $rac{1}{ au}$

: 单位时间内非平衡载流子的复合几率

 $\Delta p \frac{1}{\tau}$

: 单位时间单位体积净复合消失的

电子空穴对数 - -复合率



• 4.2 非平衡载流子的寿命

(3)非平衡少子寿命的计算 $(n型半导体,非平衡少子: \Delta p)$

一束光照下的非平衡载流子为: $\Delta n \times \Delta p$

t=0时刻停止光照,非平衡载流子 $(\Delta p)_0$

经过t秒后,非平衡少子浓度 $\Delta p(t)$,还有 $\Delta p(t)$ 没有复合

经过 $t + \Delta t$ 秒后, 非平衡少子浓度 $\Delta p(t + \Delta t)$

$$\Delta t$$
内复合的少子数 $\Delta p(t) - \Delta p(t + \Delta t) = \frac{\Delta p(t)}{\tau} \Delta t$

• 4.2 非平衡载流子的寿命

(3)非平衡少子寿命的计算 $(n型半导体,非平衡少子: \Delta p)$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\Delta p(t + \Delta t) - \Delta p(t)}{\Delta t} = -\frac{\Delta p(t)}{\tau} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{d\Delta p(t)}{dt} = -\frac{\Delta p(t)}{\tau}$$

小注入时 τ 是一常量,代入初始条件解得:

$$\Delta p(t) = (\Delta p)_0 e^{-t/\tau}$$
 撤销光照后,少数载流子浓度随 t 的衰减规律

$$t=\tau$$
: $\Delta p(\tau) = (\Delta p)_0 / e$
非平衡载流子浓度衰减到原来的1/e所需时间

• 4.2 非平衡载流子的寿命

(3)非平衡少子寿命的计算 $(n型半导体,非平衡少子: \Delta p)$

τ: 非平衡载流子的平均生存时间, τ越小, 衰减越快

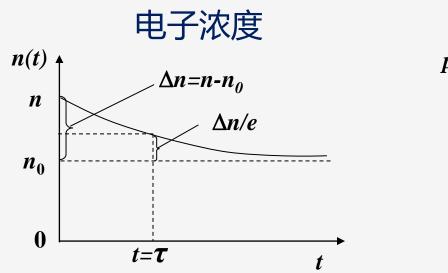
dt时间内有 $d\Delta p(t)$ 个少子复合,其生存时间为t,可以求所有少数载流子的平均生存时间:

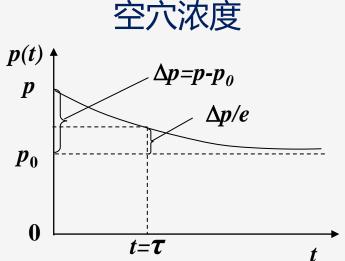
$$\bar{t} = \int t d\Delta p(t) / \int d\Delta p(t) = \int_0^\infty t e^{-t/\tau} dt / \int_0^\infty e^{-t/\tau} dt = \mathcal{T}$$

• 4.2 非平衡载流子的寿命

(4)寿命的测量结果

在 $\Delta p(t)$ 曲线上,纵坐标等于 $(\Delta p)_0 / e$ 对应的t,即为测量的少数载流子寿命。





• 4.2 非平衡载流子的寿命

(5)几种材料的非平衡少数载流子寿命

- ➤ 完整的Ge单晶10⁴μs
- > 完整的Si单晶10³ μs
- ➤ GaAs: 10⁻⁸- 10⁻⁹ s , 寿命短

同一种材料,不同条件下,寿命差别可以很大

• 4.2 非平衡载流子的寿命

(5)几种材料的非平衡少数载流子寿命

载流子的激发与复合过程

在热平衡下

 \rightarrow 满足 $pn=n_i^2$

非平衡态下

- \rightarrow 若有载流子的注入, $pn>n_i^2$
- > 通过光注入或电注入

恢复到平衡态

- > 释放能量
- > 直接复合或间接复合

- 4.3 非平衡态下载流子浓度的表示法,准费米能级
 - 平衡态系统电子和空穴具有统一的费米能级

$$n_0 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T})$$
 $p_0 = N_v \exp(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T})$

当系统平衡态被破坏时,可以认为导带和价带分别处在各自的 平衡态,只是导带和价带之间处于非平衡态,分别引入导带费 米能级和价带费米能级,是局部的费米能级—"准费米能级"。

$$n = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F^n}{k_0 T}) \qquad p = N_v \exp(-\frac{E_F^p - E_v}{k_0 T})$$

原因:

- 1. 能带范围内热跃迁非常频繁,极短时间内就能达到热平衡。
- 2. 能带之间的热平衡由于跃迁稀少, 达成平衡速度缓慢。

- 4.3 非平衡态下载流子浓度的表示法,准费米能级
 - 引入准费米能级后,非平衡状态下的载流子浓度为:

利用 n_0 和 p_0 将上式改写:

$$n = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F^n}{k_0 T}) = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F + E_F - E_F^n}{k_0 T}) = n_0 \exp(\frac{E_F^n - E_F}{k_0 T})$$

$$p = N_v \exp(-\frac{E_F^p - E_v}{k_0 T}) = N_v \exp(-\frac{E_F^p - E_F + E_F - E_v}{k_0 T}) = p_0 \exp(\frac{E_F - E_F^p}{k_0 T})$$

- 4.3 非平衡态下载流子浓度的表示法,准费米能级
 - 引入准费米能级后,非平衡状态下的载流子浓度为:

$$n > n_0$$
, $E_F^n > E_F$ 导带准费米能级更加靠近导带底

 $p>p_0$, $E_F^p < E_F$ 价带准费米能级更加靠近价带顶

• 4.3 非平衡态下载流子浓度的表示法,准费米能级

例: p型半导体, 小注入条件下

$$\Delta n \gg n_0, \ \Delta p \ll p_0$$

即: $n \gg n_0, \ p \approx p_0$

$$E_F^n$$
显著偏离 E_F
 E_F^p 偏离 E_F 很少

$$n = n_0 \exp(\frac{E_F^n - E_F}{k_0 T})$$

$$p = p_0 \exp(\frac{E_F - E_F^p}{k_0 T})$$

$$E_i$$
 ______ E_F^n E_V^p p型半导体

• 4.3 非平衡态下载流子浓度的表示法, 准费米能级

例: p型半导体, 小注入条件下

 E_c _____

载流子浓度乘积:

$$np = n_0 p_0 \exp(\frac{E_F^n - E_F^p}{k_0 T}) > n_i^2$$

$$E_i$$
 _____ E_F^n E_V^p E_V^p

E_F^n 和 E_F^p 偏离的大小直接反映np和 n_i^2 相差大小

- 1. E_F^n 和 E_F^p 相差越大,偏离平衡态越多
- 2.多子准费米能级偏离平衡态费米能级少,少子偏离多

• 4.3 非平衡态下载流子浓度的表示法,准费米能级

电子和空穴的准费米能级

 E_F^n , E_F^p 同费米能级 E_F 的偏离为:

$$E_F^n - E_F = k_0 T \ln \frac{n_0 + \Delta n}{n_0} \qquad n = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F^n}{k_0 T}) = n_0 \exp(\frac{E_F^n - E_F}{k_0 T})$$

$$E_F - E_F^p = k_0 T \ln \frac{p_0 + \Delta p}{p_0} \qquad p = N_v \exp(-\frac{E_F^p - E_v}{k_0 T}) = p_0 \exp(\frac{E_F - E_F^p}{k_0 T})$$

4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.1 复合方式分类

(1)按复合过程微观机构

直接复合

导带与价带之间直接跃迁

间接复合

通过禁带中的能级 (复合中心) 复合

(2)按复合发生的位置

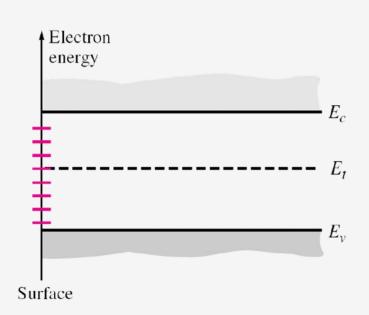
体内复合 表面复合

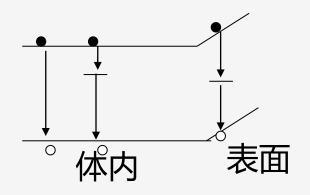
(3)按复合后载流子放出能量

发射光子 发光现象称发光复合或辐射复合

发射声子 能量给予晶格

能量给予其他载流子, 俄歇复合





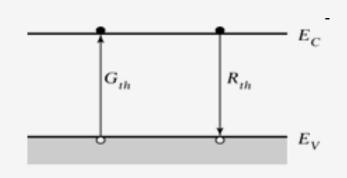
• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.2 直接复合

同一种半导体复合总是伴有产生,

当复合率>产生率: 净复合—复合过程

当复合率<产生率: 净产生—产生过程



产生率G: 单位时间单位体积中产生的电子空穴对

复合率R: 单位时间单位体积中复合的电子空穴对

净复合率 U = R - G U > 0 净复合过程

U < 0 净产生过程

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.2 直接复合

● 直接复合的净复合率

$$U_d = R - G$$
 $U_d > 0$ 净复合 $U_d < 0$ 净产生

设导带电子浓度n, 价带空穴浓度p

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.2 直接复合

A.复合率

复合率与导带中电子浓度和价带中空穴浓度成正比

$$R = rnp$$

(r为复合几率,与温度有关,与n和p无关)

平衡态复合率

$$R_0 = rn_0 p_0$$

复合率 = 产生率

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.2 直接复合

B.产生率

产生率与导带中空状态数 (不被电子占据的状态) 和价带中的电子数成正比

导带基本为空, 价带基本为满:

产生率 =
$$G$$
 = 常量 G 与 n 和 p 几乎无关
热平衡时 产生率 G_0 = 复合率 R_0 = rn_0p_0 = rn_i^2

∴产生率
$$G = G_0 = rn_i^2$$

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.2 直接复合

C. 直接净复合率

$$U_d = R - G = r(np - n_i^2) = r(n_0 + p_0)\Delta p + r(\Delta p)^2$$

● 只存在直接复合时,非平衡载流子寿命:

$$\tau = \frac{\Delta p}{U_d} = \frac{1}{r[(n_0 + p_0) + \Delta p]} \qquad U_d = \frac{\Delta p}{\tau}$$

$$U_d = r(n_0 + p_0)\Delta p + r(\Delta p)^2 \qquad \tau = \frac{\Delta p}{U_d}$$

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.2 直接复合

◆小注入

$$\Delta p << (n_0 + p_0)$$
 $\tau = \frac{1}{r(n_0 + p_0)}$

$$n$$
型半导体, $\tau = \frac{1}{rn_0}$

 n_0 增加,寿命减小。所以,电导率大,寿命小

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.2 直接复合

◆大注入

$$\Delta p \gg n_0 + p_0$$
, $\tau = \frac{1}{r\Delta p}$ 寿命不为常数,随少子数量减少而增加

室温下本征半导体:

硅: $r=10^{-11}cm^3/s \rightarrow \tau=3.5s$

锗: $r=6.5\times10^{-14}cm^3/s \rightarrow \tau=0.3s$

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

复合中心: 杂质能级, 缺陷能级, 存在于禁带中, 起台阶作用, 深能级杂质是有效的复合中心

(1)间接复合的微观过程

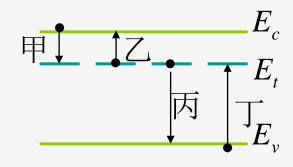
▶ 甲:复合中心从导带俘获电子;

乙:复合中心向导带发射电子;

▶ 丙:复合中心从价带俘获空穴;

▶ 丁:复合中心向价带发射空穴。

▶ 甲和乙、丙和丁分别为两对互逆过程。



甲和丁为得电子

乙和丙为失电子

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

(2)间接净复合率

复合中心浓度为 N_t , n_t 为复合中心上的电子浓度 $N_t - n_t$ 为复合中心上的空穴浓度——不被电子占据

✓ 甲过程: 电子俘获率

✓ 丙过程: 空穴俘获率

✓ 乙过程: 电子发射率

✓ 丁过程: 空穴发射率

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

(2)间接净复合率

甲:复合中心从导带俘获电子:

电子俘获率 = $r_n n(N_t - n_t)$

乙:复合中心向导带发射电子:

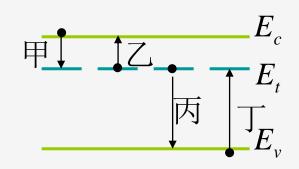
电子发射率 = $r_n n_1 n_t$

丙:复合中心从价带俘获空穴:

空穴俘获率 = $r_p p n_t$

丁:复合中心向价带发射空穴:

空穴发射率= $r_p p_1(N_t - n_t)$



$$n_1 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_t}{k_0 T})$$

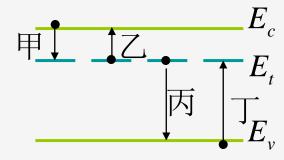
$$n_{t} = \frac{N_{t}}{1 + \exp(\frac{E_{t} - E_{F}}{k_{0}T})}$$

 r_n : 电子俘获系数,为定值 r_n : 空穴俘获系数,定值

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

● 复合中心上得到的电子数=失去的电子数:





• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

$$r_n n(N_t - n_t) - r_n n_1 n_t = r_p p n_t - r_p p_1 (N_t - n_t)$$

解得:
$$n_t = N_t \frac{(nr_n + p_1r_p)}{r_n(n+n_1) + r_p(p+p_1)}$$

复合中心上的电子浓度

非平衡载流子净复合率 $U = \Psi - Z = \overline{D} - \overline{D} = r_n n(N_t - n_t) - r_n n_1 n_t$

代入
$$n_t$$
, 得 $U = \frac{N_t r_n r_p (np - n_i^2)}{r_n (n + n_1) + r_p (p + p_1)}$

$$n_1 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_t}{k_0 T})$$

$$p_1 = N_v \exp(-\frac{E_t - E_v}{k_0 T})$$

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

(3)复合率及寿命分析

A.平衡态:

$$U = \frac{N_{t}r_{n}r_{p}(np - n_{i}^{2})}{r_{n}(n + n_{1}) + r_{p}(p + p_{1})}$$

$$n = n_0, p = p_0, np - n_i^2 = 0$$

$$U = \frac{N_t r_n r_p (np - n_i^2)}{r_n (n + n_1) + r_p (p + p_1)} = 0$$

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

(3)复合率及寿命分析

$$U = \frac{N_{t}r_{n}r_{p}(np - n_{i}^{2})}{r_{n}(n + n_{1}) + r_{p}(p + p_{1})}$$

B. $np > n_i^2, U > 0$, 净复合 $np < n_i^2, U < 0$, 净产生

C. 有效复合中心能级的位置(U最大对应的 E_t 的位置)

设
$$r_n = r_p = r$$
 $U = \frac{N_t r(np - n_i^2)}{n + n_1 + p + p_1}$

$$n_1 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_t}{k_0 T}) = n_i \exp(-\frac{E_i - E_t}{k_0 T})$$
 $p_1 = n_i \exp(-\frac{E_t - E_t}{k_0 T})$

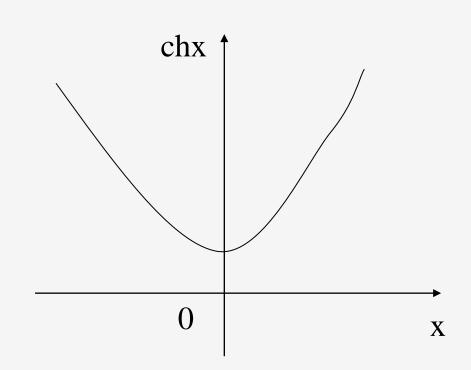
• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

(3)复合率及寿命分析

$$U = \frac{N_t r(np - n_i^2)}{n + p + 2n_i ch(\frac{E_t - E_i}{k_0 T})}$$

双曲余弦
$$chx = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$



x = 0, chx最小,即: $E_t = E_i$, U最大

E_{i} 在 E_{i} 的附近为有效复合中心!

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

$$U = \frac{N_{t}r_{n}r_{p}(np - n_{i}^{2})}{r_{n}(n + n_{1}) + r_{p}(p + p_{1})} \qquad U = \frac{\Delta p}{\tau}$$

讨论:小注入情况下两种导电类型和不同掺杂程度的半导体中 **非平衡载流子的寿命**,

$$\tau = \frac{r_n(n_0 + n_1) + r_p(p_0 + p_1)}{N_t r_n r_p(n_0 + p_0)}$$
 (假设 $\Delta p = \Delta n$)

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

① 强n型半导体

$$\tau = \frac{r_n(n_0 + n_1) + r_p(p_0 + p_1)}{N_t r_n r_p(n_0 + p_0)}$$

可以认为: n_0 远大于 p_0 、 n_1 、 p_1

$$\tau = \tau_p \approx \frac{1}{N_t r_p}$$

② 强p型半导体

$$p_0 最大$$

$$\tau = \tau_n \approx \frac{1}{N_t r_n}$$



N,为复合中心浓度

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

(4)表面复合

- 表面粗造,表面缺陷多的样品,其少子寿命短 - 表面复合
- 表面处杂质及缺陷能级引入复合中心能级 - 间接复合

- ▶可以用间接复合理论处理表面复合
- ▶与表面状态紧密相关
- ▶实际寿命是体内复合和表面复合的综合结果

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.3 间接复合

(4)表面复合

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_v} + \frac{1}{\tau_s} \qquad \tau_v \quad \text{体内复合寿命}$$

$$\frac{\tau}{\tau_v} = \frac{\tau_v}{\tau_s} + \frac{\tau_s}{\tau_s} \qquad \tau_s \quad \text{表面复合寿命}$$

表面复合率 U_s : 单位时间通过单位表面积复合掉的电子 - 空穴对

$$U_s = s(\Delta p)_s$$
 s为表面复合速度,描述表面复合的强弱

由于表面复合而失去的非平衡载流子,就如同表面处的非平衡载流子 $(\Delta p)_s$,以s大小的垂直速度流出表面。

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

4.4.4 俄歇复合

载流子从高能级向低能级跃迁,电子和空穴复合,把多余的能量传给另一个载流子,使这个载流子被激发到能量更高的能级上,当该载流子重新回到低能级上的时候,将多余的能量以声子的方式放出,称俄歇复合,是一种非辐射复合。

- > 通常在窄禁带半导体和高温情况下起重要作用
- ▶与杂质和缺陷有关的俄歇复合,是影响半导体光电器件发光效率的重要因素。

• 4.4 复合理论 非平衡载流子的寿命取决于载流子复合过程

影响非平衡少子寿命的因素

- ◆ 材料的完整性
- ◆ 杂质原子引入的深能级 (复合中心)
- ◆ 表面状态
- ◆ 高能粒子和射线的辐射,造成晶格缺陷,也影响少子寿命